STAMPER FOR ROTARY RECORDING MEDIUM AND THE MULTACTURE

Patent Number: JP59193560
Publication date: 1984-11-02

Inventor(s): ARITA KOUICHIROU

Applicant(s): DAICEL KAGAKU KOGYO KK

Application Number: JP19830068920 19830419

Priority Number(s):

IPC Classification: G11B7/24

EC Classification:

Equivalents:

Ŷ

# **Abstract**

PURPOSE:To obtain easily a stamper having excellent performance by forming successively an information transfer layer consisting of a material having high surface hardness and an intermediate layer consisting of a metal by a vacuum film forming method then forming a backing layer by an electroforming method. CONSTITUTION:An information transfer layer 2 consisting of a material having high surface hardness is formed by a vacuum film forming method on a matrix 1 for duplication and further an information transfer layer and a backing layer 4 are adhered thereto. An intermediate layer 3 playing the role of permitting electroforming of the backing layer is thereafter formed by a vacuum film forming method thereon in the same vacuum vessel. The information transfer layer and the backing layer adhered by the intermediate layer are stripped from the matrix for duplication and a stamper is obtd. Cr. Cr-Co alloy, corundum, TiN, TiC and SiC are used for the information transfer layer and Fe, Ni, Cu and Sn are used for the intermediate layer.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

1 of 1

# (9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

7426-5D

昭59—193560

**ூInt.** Cl.³ G 11 B 7/24 // B 29 D 17/00 G 11 B 3/70 11/00 識別記号 庁内整理番号 B 8421-5D 6653-4F 7247-5D 砂公開 昭和59年(1984)11月2日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

❷回転記録体用スタンパー及びその製造法

姫路市北新在家一丁目六番二号

の出 願 人 ダイセル化学工業株式会社

堺市鉄砲町1番地

個代 理 人 弁理士 古谷馨

20特 顧 昭58-68920

@出 願 昭58(1983) 4月19日

仰発 明 者 有田孝一郎

発明の名称

回転配録体用スタンパー及びその製造

#### 2 特許請求の範囲

- 1 表面硬度の高い物質よりなる情報転写層と、 パッキング層と、これら二つの層を接着せし める導電性を有し且つ酸化被膜が出来にくい か、出来ても除去し易い金属よりなる中間層 から成り、情報転写層の厚みが 0.05~10 A、 中間層の厚みが 0.05 ~ 10 μ、 パッキング層 の厚みが 0.1 ~ 1.0 xx である回転配録休用ス タンパーロ
- 2 安面硬度の高い物質がクロム・クロム・コ パルト合金,コランダム,窒化チタン,炭化 チタン又は炭化珪素であり、 パッキング層が ニッケル又は銅からなり、中間層の金属が鉄 ニッケル・銅叉は錫である特許請求の範囲第 1 項記載の回転記録体用スタンパー。
- レリーフ状の情報を担つた複製母型上に表

面硬度の高い物質からなる情報転写層と、導 電性を有し且つ酸化被膜が出来にくいか、出 来ても除去し易い金属よりなる中間層を順次 真空成膜法により形成させ、しかる後パッキ ング層を電饒法により形成させ、上記中間層 により接着された情報転写層とパッキング層 を上記母型から剝離して得ることを特徴とす る回転記録体用スタンパーの製造法。

- 安面硬度の高い物質がクロム・クロム コ パルト合金・コランダム・窒化チタン・炭化 チタン又は炭化珪素であり、パッキング層が ニッケル又は銅からなり、中間層の金属が鉄、 ニッケル・銅叉は錫である特許請求の範囲第 3項記載の回転記録体用スタンパーの製造法。
- 3 祭明の詳細を脱明

本発明は回転記録体用スタンパー及びその製 遺法に関し、その目的とする所は情報転写性が すぐれ、且つ寿命の長いスタンパーを容易に得 ることにある。

プラスチックスの円盤上に敬細な凹凸として

# 特周昭50-193560 (4)

だちに行ない、 かつ酸化膜除去の前処理を行な うことが窺ましい。

かくして本発明によって得られるスタンパーは複製母型上に直接表面硬度の高い情報を登した。ないではなって、かったのを受けるため、母型の凹凸の信号が最近ないでなく正確に転写されていて、かったのをなって、かった信号はブラスチックの繰返し成形によって、ないのでは中間層により密着性よく接着されている。

以下に本発明を実施例をもつて説明する。 実 施 例

鏡面研磨した直径 356 転・厚さ6 型のガラス 円盤上に Shipley 社のポツ型レツスト A Z 1350 をスピンコーターで 700 Å 厚さに均一にコート し、ピーム径をしぼつた Ar レーザー光により巾 0.8 µ・ピッチ 2.5 µでスパイラル状に感光させた後現像して、深さ 700 Å , 巾 0.8 µ , ピッチ 2.5 µの癖を有する原盤を得た。この原盤上にクロム及びニッケルの二つのターゲットを有

するマグネトロン式スパッタリング装置により、 クロム及びニッケルを順次それぞれ約 1000 Å 原盤上に成膜させた。との際クロムをスパッタ - した後、真空を破るととなくただちにニッケ ルをスパツォーするととにより、クロム層(情 報転写層)とその上のニッケル層(中間層)と の中間に酸化物層が形成されるととがなく、と の両者は密着性よく積層された。かかるニッケ ル眉で表面を覆われた原盤をただちに 1 5 重量 **豸のスルフアミン酸溶液で処理した後、スルフ** アミン酸ニッケル(四水和物) 400 8/L, 塩化 ニッケル(六水和物) 5 8/4 , ほう酸 30 8/4, ピット防止剤 0.5 8/2 からなる電鋼浴に浸漬し、 垂直面に対し45°の角度を保ちつつ電解ニッケ ルペレツトをいれたアノードポックスに対向し て回転せしめ、50 Cで227 A·hr 通電せしめて、 電鍋を行なつた。しかる後に原盤より電鏡物を 剝離し、原盤の排が反転転写された厚さ 0.5 mm のスタンパーを得た。

かくして得られたスタンパーを直径 527 \*\*\*.

厚さ 1.2 取のポリメチルメタクリレート樹脂のデイスクの射出成形に用い、一万ショットの成形の後、デイスクに転写された構形状を薄膜段差計により調べたところ、約500 ショット目のデイスクと約一万ショット目のデイスクにおいて、溝形状に有意差が認められなかつた。

# 4 図面の詳細な説明

第1図はレリーフ状複製母型上にスタンパーが形成される状態を示す断面図、第2図は母型から剝離されたスタンパーを示す断面図である。1…複製母型、2…情報転写層、3…中間層、4…パッキング層

